

## エジェクタシステム／真空ポンプシステム

真空システムの核となるエジェクタシステムと真空ポンプシステム。  
単体タイプから、各種関連機器を複合させた  
ユニットタイプを各種用意しています。

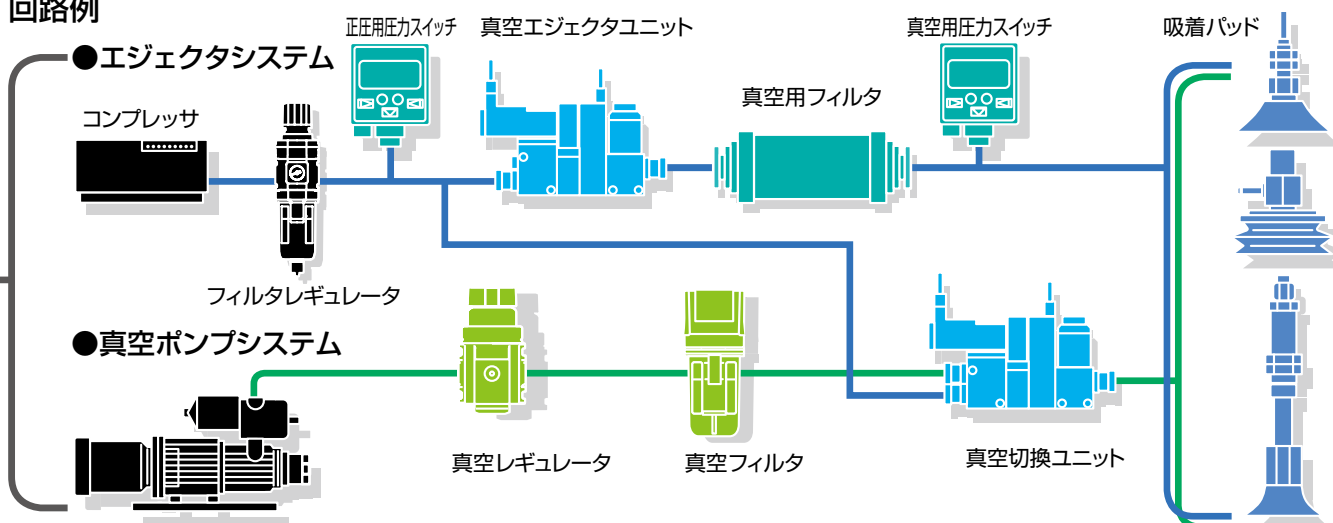


## 吸着パッド

ワークを直接吸着するアタッチメント。  
対象ワークのサイズ、重量、特性に合わせて、  
多種多彩な材質、形状、パッド径を用意しています。



### 回路例



## 真空関連機器

真空破壊バルブ、真空用圧力スイッチ、真空用フィルタ等、  
真空システムの使い方に合わせて、  
各種関連機器を用意しています。



## 関連機器

真空フィルタ、真空レギュレータ、クイックバルブ、  
精密吸着プレート、バッファユニット等、  
より高度な真空システムに適した関連機器を用意しています。

